

金属-半导体界面欧姆接触的原理、测试与工艺



作者：吴鼎芬，颜本达编著

出版社：上海：上海交通大学出版社

出版日期：1989. 03

总页数：216

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10697878.html>) 查找全本阅读方式

金属-半导体界面欧姆接触的原理、测试与工艺 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10697878.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10697878.html>

书名：金属-半导体界面欧姆接触的原理、测试与工艺